

## 装置・技術担当者一覧

総責任者：入船 徹男

## A. センター設置装置・技術

I. 超高压装置群（超高压実験装置と関連装置）			
	[通称]	[装置型番]	[管理・実施責任者]
(1)	マルチアンビル超高压発生装置	Orange-1000	西原遊, 新名亨
(2)	マルチアンビル超高压発生装置	Orange-3000	大内留博, Steeve Gréaux, 新名亨
(3)	D-DIA型超高压変形装置	Madonna I	大内留博, 西原遊, 新名亨
(4)	DIA型焼結ダイヤモンドアンビル超高压装置	Madonna II	新名亨, 大内留博
(5)	ダイヤモンドアンビルセル	DAC	境毅
(6)	DAC用ファイバーレーザー加熱システム	Fiber laser	境毅
(7)	DAC用CO <sub>2</sub> レーザー加熱システム	CO <sub>2</sub> laser	境毅
(8)	マルチアンビル装置用高圧下弾性波速度測定装置	Ultrasonic	TDS5104 河野義生, Steeve Gréaux
II. 微小試料分析装置（電子顕微鏡および関連装置とX線回折・分光装置等）			
(9)	電界放出型走査電子顕微鏡（EDS付き）①	FE-SEM-EDS	JSM-7000F 大内留博, 井上紗綾子
(10)	電界放出型走査電子顕微鏡（EBSDF付き）	FE-SEM-EBSDF	JSM-7000F 大内留博, 井上紗綾子
	電界放出型走査電子顕微鏡（EDS付き）②		JSM-IT500HR 大内留博, 井上紗綾子
(11)	走査型電子顕微鏡（EDS付き）	SEM-EDS	JSM-6510LV 大内留博, 井上紗綾子
(12)	分析透過型電子顕微鏡（電界放出型）	FE-TEM	JEM-2100F 大内留博, 井上紗綾子
(13)	透過型電子顕微鏡（熱電子銃型）	TEM	JEM-2010 大内留博, 井上紗綾子
(14)	集束イオンビーム（デュアルビーム）加工装置	Dual Beam FIB	Scios 境毅, 井上紗綾子
(15)	集束イオンビーム加工装置	FIB	JEM-9310FIB 境毅, 井上紗綾子
(16)	微小領域X線回折装置	Micro-focus XRD	RAPIDII-V/DW 境毅, 新名亨, 桑原秀治
(17)	粉末X線回折装置	Powder XRD	UltimaIV/DD 新名亨, 桑原秀治
(18)	顕微ラマン分光装置（日本分光）	Micro-Raman Spectroscopy	NRS-5100gr 境毅, 桑原秀治, 新名亨
(19)	顕微ラマン分光装置（Photon Design）	Micro-Raman Spectroscopy	RSM 800 境毅, 新名亨
(20)	顕微近赤外レーザーラマン分光装置	Micro-Raman (NIR) Spectroscopy	NRS-4500 境毅, 桑原秀治, 新名亨
(21)	顕微赤外分光装置	FT-IR	IRT-5200EUO 西原遊, 新名亨
(22)	紫外可視近赤外分光システム	UV-Vis-NIR	V-670 新名亨
(23)	レーザー顕微鏡	Laser microscope	OPTELCIS HYBRID L3 新名亨
(24)	イオン研磨加工装置（イオンスライサ）	Ion Slicer	EM-09100 IS 大内留博, 井上紗綾子
(25)	イオン研磨加工装置（アルゴンイオンミリング）	PIPS	Model 691 大内留博, 井上紗綾子
	白金・金・カーボン蒸着装置	Coater	Neoc-STB/JFC-1600/JEC-560 大内留博, 井上紗綾子
III. 加工装置・その他の特徴ある装置			
(26)	超音波加工機		UM-150CS 西原遊, 大内留博
(27)	自動パーツ加工機①		MDX-540 新名亨, Steeve Gréaux
	自動パーツ加工機②		MDX-40a 西原遊, 新名亨, Steeve Gréaux
(28)	高温雰囲気炉①	大型炉	ATCM50-100/1700 西原遊, 新名亨
(28)	高温雰囲気炉②	小型炉	TS-4B06 西原遊, 新名亨
(29)	マイクロピッカース硬度計		HMV-G21DT 新名亨
	大型平面研磨盤		GS-BMHF 新名亨, Steeve Gréaux, 桑原秀治
	精密ボール盤		JIG-3M-1 西原遊, 新名亨, 大内留博
	コンターマシン		V-33 西原遊, 新名亨
	自動研磨機		EcoMet3000 西原遊, 新名亨
	ファイバーレーザー加工装置①	DAC用	FL-LM 01 境毅, 新名亨
	ファイバーレーザー加工装置②	MA用	ML-7111A 西原遊, 新名亨
	ダイヤモンド研磨機		MCBS-320 入船徹男, 新名亨
	大型NCタッピング装置		MTV-T310; KIRA, PCV-30 新名亨
	CCD形状観察装置（キーエンス）		VHX-2000 新名亨
	デジタルマイクロスコープ（ライカ）		DVM6 新名亨
	炉床昇降式高温電気炉		SPM65-17 河野義生
IV. 数値計算用コード			
(30)	流体物性シミュレーションコード		土屋卓久, 出倉春彦
(31)	数値流体シミュレーションコード		亀山真典
V. センター外設置装置・技術			
(32)	変形機構付きガイドブロック（Spring-8 BL04B1 ビームライン）		西原遊, 大内留博
(33)	X線その場観察弾性波速度測定装置（Spring-8 BL04B1 ビームライン）		河野義生, Steeve Gréaux
	高速カメラ（Spring-8 BL04B1 ビームライン）		FASTCAM Mini AX100 河野義生
VI. センター合成のナノ多結晶ダイヤモンド（ヒメダイヤ）			
	各種の応用研究用としてヒメダイヤの合成ならびに最適加工	NPD	入船徹男, 新名亨